

試料作製室の利用案内

場所:千現地区 精密計測実験棟 103 室

■利用可能時間と利用対象者

- 利用可能時間は平日 9:00~16:30 です。
(NIMS 職員の夜間利用者は平日 9:00~20:30 まで)
- ライセンス保持者のみ入室可能で、ライセンスを取得した装置のみ利用可能です。
- ライセンスは年度ごとに更新手続きが必要です。
- 入退室について、NIMS 職員はご自身の ID カードで入室ください。それ以外の方はスタッフルーム(精密計測実験棟 101 室)でカードキーを借用/返却ください。

■予約ルールと利用料金

- 要予約の装置と予約不要の装置があります。
- 要予約の装置
 - ・精密イオン研磨装置 Model 691 PIPS
 - ・ディンプルグラインダー Dimple Grinder
 - ・自動精密切断機 ISOMET Low Speed Saw
 - ・精密研磨装 Multiprep System
- 操作講習は「技術補助」、ライセンス取得後は「機器利用」の利用料金がかかります。
- ライセンス取得後は、予約システムにて、1 時間単位で予約ください。
例: 10:30-12:00 は NG / 10:00-12:00 は OK
- 予約システムの入力時間は、利用料金にそのまま反映されます。一日使用する場合は休憩時間の前後で予約を分けられます。
- 1 日の予約枠の数に制限はありません。
- 予約日の前日までは予約システムでキャンセルや変更が可能です。
- 急な予約のキャンセルや変更をご希望の際は、電子顕微鏡ユニット事務局 (tem@nims.go.jp) および担当スタッフにご連絡ください。
- 予約不要の装置
 - その他の装置(コーター類等)は、ライセンス保持者であれば、予約なしで利用可能です。ただし、他のユーザーと時間が被る可能性があることを予めご了承ください。
 - 操作講習は「技術補助」の利用料金がかかりますが、ライセンス取得後の「機器利用」は非課金です。

TEM 試料作製装置群の装置リスト

要予約



■自動精密切断機 ISOMET Low Speed Saw

- ・低速回転/軽荷重
- ・4 インチダイヤモンド切断砥石
- ・ブレード回転数: 0~300 rpm



■精密イオン研磨装置 Model 691 PIPS

- ・加速電圧: 0.1~6 kV
- ・研磨角: $\pm 10^\circ$ (0.1°ステップ)
- ・使用ガス: アルゴン
- ・液体窒素冷却ステージ



■精密研磨装置 Multiprep System

- ・試料傾斜角度: 0~10°
- ・研磨盤回転速度: 5~350 rpm
- ・試料研磨荷重: 0~600 g
- ・精密マイクロメーター付き



■ディンプルグラインダー Dimple Grinder

- ・試料研磨ホイール径: 15 mm
- ・試料研磨荷重: 0~40 g
- ・研磨ホイール回転速度: 0~600 rpm
- ・初期試料厚さ: 200 μm 以下
- ・自動停止機構付き

予約不要



- ・カーボンコーター JEC-560
- ・白金コーター JFC-1600
- ・金コーター JFC-1500
- ・オスmiumコーター HPC-1SW
- ・ターボ式真空蒸着機 SVC-700 (蒸着源要持参)
- ・親水化処理装置 DII-29020HD
- ・その他 (ホットプレート等)